

Spécialité de Master « Optique, Matière, Plasmas »

Stage de recherche (4 mois minimum, à partir de début mars 2011)

Proposition de stage pour l'année 2010-2011 (ne pas dépasser 1 page)

Date de la proposition :

Responsable du stage / internship supervisor:			
Nom / name:	DELMOTTE	Prénom/ first name :	Franck
Tél :	01 64 53 32 60	Fax :	
Courriel / mail:	Franck.delmotte@institutoptique.fr		
Nom du Laboratoire / laboratory name:			
Code d'identification :	UMR	Organisme :	Institut d'Optique
Site Internet / web site:	www.institutoptique.fr / www.scop.u-psud.fr		
Adresse / address:	Campus Polytechnique – RD128 – 91127 Palaiseau		
Lieu du stage / internship place:	bât. 503 campus d'Orsay		

Titre du stage / internship title: Etude de structures nanométriques par réflectométrie des rayons X
<p>Les miroirs interférentiels XUV, composé d'un empilement périodique de films minces d'épaisseur nanométrique, ont largement démontré leur intérêt dans de nombreux domaines scientifiques et technologiques : optiques pour rayonnement synchrotron, diagnostiques de plasma chaud (laser MégaJoule), physique solaire, lithographie EUV, impulsions ultra brèves (attosecondes) etc. Fortement impliqué dans le domaine de l'optique XUV (longueurs d'onde de 1 à 60 nm) depuis près de vingt ans, le LCFIO a notamment réalisé les miroirs revêtus de multicouches pour les télescopes imageurs EUV de la mission d'observation solaire STEREO (lancés en octobre 2006 par la NASA). La réflectométrie des rayons X rasants est la technique de base indispensable pour mener des études sur les empilements de couches nanométriques car elle donne accès, en combinant mesures et simulations, aux paramètres structuraux expérimentaux des multicouches : épaisseurs, rugosité aux interfaces, densité des matériaux déposés.</p> <p>L'équipe Optique XUV du LCFIO va se doter début 2010 d'un nouvel équipement de réflectométrie X (longueur d'onde 0.154 nm) combinant une source à optique collimatrice et une platine porte échantillon entièrement motorisée. La dimension de la zone exposée et la concentration du flux attendus avec ce nouveau montage permettront d'analyser les échantillons sur des zones bien localisées et avec une meilleure sensibilité. Ce réflectomètre sera aussi équipé d'une chambre en température permettant un chauffage <i>in situ</i> de l'échantillon jusqu'à 1000°C.</p> <p>L'objectif de ce travail de stage sera de mettre en œuvre et d'étudier la précision et les limites de ce nouveau montage. Le candidat pourra également participer à la conception et au dépôt des empilements multicouches, ainsi qu'aux campagnes de test sur rayonnement synchrotron.</p>
Toutes les rubriques ci-dessous doivent obligatoirement être remplies

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI			
Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: EDOM			
Lasers et matière		Lumière, Matière : Mesures Extrêmes	X
Optique de la science à la technologie	X	Physique des plasmas	

Fiche à transmettre (fichier pdf **obligatoirement**) sur le site <http://stages.master-omp.fr>